

Verejný obstarávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 288, 974 01 Banská Bystrica

Názov zákazky: Elektronový mikroskop s príslušenstvom

Názov projektu: Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa, ITMS kód projektu: 310011V993

Operačný program Kvalita životného prostredia

Uchádzač:

Názov Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.

Sídlo Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava 3

IČO 46 095 969

Platba DPH áno

IČ DPH: SK2023226777

DIČ: 2 023 226 777

Kontakt (tel.): +421 255 646 781, 91

## Návrh uchádzača na plnenie kritéria

|               |                                        |         |          | 1                        | 2                           | 3                            | 4           | 5                          |
|---------------|----------------------------------------|---------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|
| Názov položky |                                        | IVT     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v EUR | Celková cena bez DPH v EUR* | Sadzba DPH (ak relevantná)** | Suma DPH**  | Celková cena s DPH v EUR** |
| 1.            | Elektronový mikroskop s príslušenstvom | komplet | 1        | 179 260,00 €             | 179 260,00 €                | 20 %                         | 35 852,00 € | 215 112,00 €               |
| SPOLU         |                                        |         |          |                          | 179 260,00 €                |                              |             | 215 112,00 €               |

\* V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH v stĺpci 2 uvádza konečnú cenu

\*\* V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH stĺpce 3,4,5 nevyplní

Uvedená cena zahŕňa všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom zákazky vrátane dopravy

## Návrh technického plnenia uchádzača

| Technická špecifikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Návrh technického plnenia***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Skenovací elektronový mikroskop s možnosťou práce vo vysokom a nízkom vákuu s katódou typu FE Schottkyho emitör, LaB6 alebo ekvivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detektory SE, BSD a EDS</li> <li>- Energetické rozlíšenie EDS detektora: MnKa, min. 20 000 cps pri 130 eV</li> <li>- Možnosť vkladania vzoriek do komory skenovacieho elektronového mikroskopu s priemerom min. 200 mm</li> <li>- Rozlíšenie vo vysokom vákuu: min. 3 nm pri 30 kV a min. 8 nm pri 3 kV</li> <li>- Hraničná hodnota tlaku v nízkom vákuu 400 Pa alebo lepšia</li> <li>- Urýchľovacie napätie v rozsahu min. 0,3 kV - 30 kV</li> <li>- Prúd sondy v rozsahu min. 2 pA - 200 nA</li> <li>- Priame zväčšenie v rozsahu min. 8x - 300 000x</li> <li>- Analytická pracovná vzdialenosť max. 10 mm</li> <li>- Kompucentrický alebo eucentrický stolík s pohybom min. v 5 osiach x, y, z, T a R;</li> <li>- X = min. 80 mm, Y = min. 40 mm, Z = min. 35 mm, T = min. v rozsahu -30° až +50°, R = min. 360°</li> <li>- Color CCD náhľadová kamera</li> <li>- Navigačná kamera</li> <li>- Príslušenstvo:</li> <li>- * Naprašovačka (Sputter coater)</li> <li>- * Zariadenie na prípravu vzoriek CPD (critical point dryer)</li> </ul> <p>Pri stroj musí byť kompatibilný v korelatívnej mikroskopii s optickými mikroskopmi ZEISS, ktoré verejný obstarávateľ vlastní.</p> | <p>Skenovací elektronový mikroskop ZEISS SEM Evo 10 VP s možnosťou práce vo vysokom a nízkom vákuu s katódou typu LaB6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detektory SE, BSD a EDS Oxford Instruments Oxford Xplore15 w/AZtecOne</li> <li>- Energetické rozlíšenie EDS detektora: MnKa, 100 000 cps pri 130 eV</li> <li>- Možnosť vkladania vzoriek do komory skenovacieho elektronového mikroskopu s priemerom 230 mm</li> <li>- Rozlíšenie vo vysokom vákuu: 2 nm pri 30 kV a 6 nm pri 3 kV</li> <li>- Hraničná hodnota tlaku v nízkom vákuu v rozsahu od 10 - 400 Pa</li> <li>- Urýchľovacie napätie v rozsahu min. 0,2 kV - 30 kV</li> <li>- Prúd sondy v rozsahu min. 0,5 pA - 5 µA</li> <li>- Priame zväčšenie v rozsahu min. 7x - 1 000 000x</li> <li>- Analytická pracovná vzdialenosť 8,5 mm</li> <li>- Kompucentrický stolík s pohybom min. v 5 osiach x, y, z, T a R;</li> <li>- X = 80 mm, Y = 100 mm, Z = 35 mm, T = v rozsahu -30° až +50°, R = 360° kontinuálne</li> <li>- Color CCD náhľadová kamera</li> <li>- Navigačná kamera</li> <li>- Príslušenstvo:</li> <li>- * Naprašovačka (Sputter coater) Quorum SC7620</li> <li>- * Zariadenie na prípravu vzoriek CPD (critical point dryer) K850 Quorum Technologies</li> </ul> <p>Pri stroj je kompatibilný v korelatívnej mikroskopii s optickými mikroskopmi ZEISS, ktoré verejný obstarávateľ vlastní. Softvér ZEISS ZEN Core s možnosťou modulu ZEN Toolkit Connect</p> |

\*\*\* Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný výrobok (značku, typ a uvedie technické parametre ponúkaného výrobku, ktoré vyhovujú požadovanej technickej špecifikácii).

V: Bratislava

Dňa: 1.8.2023

Vypracoval: RNDr. Peter Letovanec

Mgr. M. r. o.

(Titul, meno, priezvisko)

Podpis a pečiatka osoby oprávnenej konať za uchádzača (pečiatka ak relevantná)

Uchádzač vyplní šté polia